

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 5 部門第 2 区分
 【発行日】 平成 18 年 11 月 30 日 (2006.11.30)

【公表番号】 特表 2006-504056 (P2006-504056A)
 【公表日】 平成 18 年 2 月 2 日 (2006.2.2)
 【年通号数】 公開・登録公報 2006-005
 【出願番号】 特願 2004-546977 (P2004-546977)
 【国際特許分類】

F 1 6 M 1/00 (2006.01)

F 1 6 M 7/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

F 1 6 M 1/00 R

F 1 6 M 7/00 Z

H 0 1 L 21/30 5 0 3 Z

【手続補正書】
 【提出日】 平成 18 年 10 月 13 日 (2006.10.13)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

微細加工ツール用のペDESTAL であって：

微細加工ツールを支持するフレーム；および

それぞれの連結ポイントで、前記フレームと各々連結された複数の支持体であって、前記複数の支持体の各支持体の前記それぞれの連結ポイントは、前記フレームに沿って、かつ前記フレームに対して相対的に、残りの前記複数の支持体のそれぞれの連結ポイントから独立して移動可能である、前記複数の支持体を具備する、前記ペDESTAL。

【請求項 2】

フレームが、直交軸によって画定される平面内に実質的に配置され、複数の支持体が、前記平面に対して直角に配され、少なくとも 1 つの支持体がフレームに沿って、かつ、前記直交軸の少なくとも 1 つに沿って、フレームに対して相対的に移動可能である、請求項 1 に記載のペDESTAL。

【請求項 3】

複数の支持体がフレームと摺動可能に連結している、請求項 1 に記載のペDESTAL。

【請求項 4】

フレームがレールを具備し、複数の支持体が前記レールと摺動可能に連結するように配される、請求項 3 に記載のペDESTAL。

【請求項 5】

フレームがチャンネルを具備し、複数の支持体が前記チャンネルと摺動可能に連結するように配される、請求項 3 に記載のペDESTAL。

【請求項 6】

複数の支持体の少なくとも 1 つが、長さ調節可能である、請求項 1 に記載のペDESTAL。

【請求項 7】

複数の支持体のうち少なくとも 1 つの支持体が、複数の支持体のうち少なくとも 1 つの

支持体の長さを調節することができるように構築され、配された、該少なくとも1つの支持体の垂直軸に実質的に沿って配置されるネジ山付き部材を具備する、請求項6に記載のペデスタル。

【請求項8】

振動を減衰する手段を具備する、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項9】

バイブレーションダンパナを具備する、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項10】

バイブレーションダンパナが弾性ポリマー材料を含む、請求項9に記載のペデスタル。

【請求項11】

バイブレーションダンパナがペデスタルの少なくとも一部の内部に配置される、請求項9に記載のペデスタル。

【請求項12】

複数の支持体の第1および第2に連結された、長さ調節可能な補強材をさらに具備する、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項13】

フレームに連結された連結補助体を具備する、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項14】

微細加工ツールを支持するように構築され、配され、フレームに連結された上部面を含む、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項15】

微細加工ツールが半導体処理ツールである、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項16】

微細加工ツールが微小電気機械処理ツールである、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項17】

フレームが拡張可能に構築され、配された、請求項1に記載のペデスタル。

【請求項18】

フレームが、フレームの拡張ができるように構築され、配された、入れ子式要素を具備する、請求項17に記載のペデスタル。

【請求項19】

フレームが、フレームの拡張ができるように構築され、配された、ネジ山付き要素を具備する、請求項17に記載のペデスタル。

【請求項20】

微細加工ツール用のペデスタルであって：

微細加工ツールを支持するフレーム；

前記フレームに取り付けられた複数の支持体；および

前記複数の支持体と前記フレームとが取り付けられる各々の位置を、残りの前記複数の支持体と前記フレームとが取り付けられる位置とは独立して、横方向に調節するための手段を具備する、前記ペデスタル。

【請求項21】

微細加工ツールのための支持を与える方法であって：

微細加工ツールを支持するフレームと、各々が、前記フレームのそれぞれの位置において、前記フレームと連結された複数の支持体とを具備するペデスタルを設けること；および

前記複数の支持体と前記フレームとが取り付けられる各々の位置を、残りの前記複数の支持体と前記フレームとが取り付けられる位置とは独立して、横方向に再配置することを含む、前記方法。

【請求項22】

フレームに所望の高さを与えるために、支持体の長さを調節することをさらに含む、請求項21に記載の方法。

【請求項 2 3】

横方向に再配置することが、取り付けフロア上の選択された位置に対して整列するように支持体を再配置することを含む、請求項 2 1 に記載の方法。

【請求項 2 4】

フレームに連結された少なくとも 1 つの静的支持体をさらに含む、請求項 1 に記載のペデスタル。

【請求項 2 5】

複数の支持体のうち少なくとも 1 つが、複数の支持体のうち他のものがフレームに沿った、フレームに対して相対的に移動する方向とは垂直な方向に、フレームに沿って、フレームに対して相対的に移動可能である、請求項 1 に記載のペデスタル。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

本明細書で用いるとき、「微細加工ツール」の用語は、機械、機器などのいずれの部分をも指し、これらはペデスタルによる支持を受けることが望ましく、寸法の小さな製品の処理のために使用されるものである。例えば、寸法の小さな製品における製品の寸法は、概して 5 0 0 ナノメートルより小さく、かつ 2 5 ナノメートルより大きい。典型的な微細加工ツールは、サブミクロンのデバイスを処理するためにクリーンルーム環境で使用される。例えば、微細加工ツールは、従来の半導体処理ツールおよび微小電気機械（MEMS）の生産用のツールを含む。本明細書で用いるとき、「ペデスタル」の用語は、ツールを支持するよう意図されたいずれの構造をも指す。本明細書で用いるとき、「フレーム」の用語は、概してツールを支持するように寸法決めされ、成形されたいずれの構造をも指す。本明細書で用いるとき、「支持体」の用語は、サブフロアなど別の構造上のペデスタルを支持するペデスタルフレームに連結された構造を指す。下記に詳細に説明されるように、支持体は、脚その他類似の構造を備えてもよい。

本明細書で用いるとき、「～に沿って移動可能」の用語は、フレームなどの指し示したポイントに沿った複数のポイントに再配置可能であることを意味する。例えば、一態様において、フレームは、直交軸によって画定される平面に実質的に横たわり、また、支持体は、この平面に実質的に垂直に配され、直交軸の少なくとも 1 つに沿ったフレームに沿って移動可能である。